

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年8月25日(2016.8.25)

【公開番号】特開2015-19016(P2015-19016A)

【公開日】平成27年1月29日(2015.1.29)

【年通号数】公開・登録公報2015-006

【出願番号】特願2013-146732(P2013-146732)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

F 26 B 5/16 (2006.01)

F 26 B 3/24 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 5 1 L

H 01 L 21/304 6 5 1 B

F 26 B 5/16

F 26 B 3/24

【手続補正書】

【提出日】平成28年7月11日(2016.7.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

乾燥対象面を有する基板をその乾燥対象面に交差する回転軸を中心として回転させる回転機構と、

前記回転機構により回転する前記基板の乾燥対象面に乾燥用液体を供給する液体供給部と、

前記回転機構により回転する前記基板の乾燥対象面上の大気を乾燥気体に置換する置換部と、

を備えることを特徴とする基板乾燥装置。